

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成23年3月10日(2011.3.10)

【公表番号】特表2010-526990(P2010-526990A)

【公表日】平成22年8月5日(2010.8.5)

【年通号数】公開・登録公報2010-031

【出願番号】特願2010-504844(P2010-504844)

【国際特許分類】

G 01 B 5/008 (2006.01)

B 23 Q 17/00 (2006.01)

B 23 Q 3/157 (2006.01)

【F I】

G 01 B 5/008

B 23 Q 17/00 Z

B 23 Q 3/157 C

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月17日(2011.1.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

座標位置決めマシンと共に使用する測定プローブのための保管装置であって、
測定プローブのための少なくとも一のレセプタクルを有する保管ユニットと、
測定プローブが少なくとも一のレセプタクルに配置される際に、測定プローブの温度を
コントロールするための少なくとも一の温源であって、前記測定プローブの座標位置決め
マシンとの接触部分の少なくとも一部をターゲットとするよう構成された少なくとも一の
温源と、

を有する保管装置。

【請求項2】

前記温源は、前記レセプタクルに配置された測定プローブの第1端をターゲットとする
ように構成される、請求項1に記載の保管装置。

【請求項3】

前記少なくとも一の温源は、前記レセプタクルに配置された前記測定プローブの座標位
置決めマシンとの接触面をターゲットとするように前記温源が構成される請求項1または
2に記載の保管装置。

【請求項4】

前記温源の少なくとも一部は、前記レセプタクルに対して変位可能である、請求項1ない
し3のいずれかに記載の保管装置。

【請求項5】

前記温源の少なくとも一部は、前記温源が前記レセプタクル内に配置された測定プロー
ブの選択された部分を越えて延在する閉じられた位置と、前記レセプタクル内に配置され
た前記測定プローブの前記選択された部分が露出される開放位置との間で、前記レセプタ
クルに対して変位可能である、請求項4に記載の保管装置。

【請求項6】

前記温源は、少なくとも一の温度要素、および、少なくとも一の温度伝導アームを有し

、前記少なくとも一の温度伝導アームは、前記レセプタクルに対して変位可能である、請求項1ないし5のいずれかに記載の保管装置。

【請求項7】

前記少なくとも一の温度要素は、前記アームが前記温度要素に対して変位可能であるように、前記少なくとも一のアームと分離して提供される、請求項6に記載の保管装置。

【請求項8】

前記少なくとも一の温度要素は、前記アームに対して固定される、請求項6に記載の保管装置。

【請求項9】

前記温源をコントロールするように構成された温度制御装置さらに含む、請求項1ないし8のいずれかに記載の保管装置。

【請求項10】

前記温度制御装置は、前記レセプタクルに配置された前記測定プローブの温度を実質的に所定温度に維持するように前記温度をコントロールするように構成される請求項9に記載の保管装置。

【請求項11】

前記所定温度は、前記測定プローブの作動温度である請求項10に記載の保管装置。

【請求項12】

前記温度制御装置は、前記レセプタクルに配置された前記測定プローブの作動温度を示している信号を温度センサーから受けるように構成され、かつ、測定プローブの温度を前記作動温度に維持するために前記温源をコントロールするように構成される請求項11に記載の保管装置。

【請求項13】

前記温度制御装置は、前記保管装置に配置された前記温度センサーから、前記レセプタクルに配置された前記測定プローブの前記作動温度を示している信号を受けるように構成される請求項12に記載の保管装置。

【請求項14】

前記温度制御装置は、前記測定プローブに配置された前記温度センサーから、前記測定プローブの前記作動温度を示している信号を受けるように構成される請求項12に記載の保管装置。

【請求項15】

前記保管ユニットは、前記レセプタクル内に配置された前記測定プローブにおいて電力を少なくとも一の電気構成部品に供給するための少なくとも一の電気コネクタを含む、請求項1ないし14のいずれかに記載の保管装置。

【請求項16】

前記少なくとも一の電気コネクタは、前記測定プローブの少なくとも一の座標位置決めマシン電力供給コネクタと接続するように構成される請求項15に記載の保管装置。

【請求項17】

前記温源は、熱源を含む、請求項1ないし16のいずれかに記載の保管装置。

【請求項18】

前記加熱要素は、抵抗器である請求項17に記載の保管装置。

【請求項19】

請求項1ないし18のいずれかに記載の保管装置と、

前記少なくとも一のレセプタクルに割り当てられた測定プローブを含むキット。

【請求項20】

保管ユニット内において座標位置決めマシンと共に使用するための測定プローブを保管する方法であって、

前記測定プローブを、前記測定プローブの座標位置決めマシンとの接触部分の少なくとも一部をターゲットとするよう構成された温源を有する前記保管ユニット内に配置すること、および、

前記温源を介して前記測定プローブの温度をコントロールすること、
を含む方法。

【請求項 2 1】

前記測定プローブの温度を実質的に所定温度に維持することを含む請求項 2 0 に記載の
方法。

【請求項 2 2】

前記所定温度は、前記測定プローブの作動温度である請求項 2 1 に記載の方法。

【請求項 2 3】

前記少なくとも一の温源は、前記レセプタクルに配置された前記測定プローブの座標位
置決めマシンとの接触面をターゲットとするように前記温源が構成される請求項 2 0 に記
載の方法。